

*A. И. ВОРОБЕЦ, к. ф.-м. н. Г. И. ВОРОБЕЦ,
д. ф.-м. н. С. В. МЕЛЬНИЧУК*

Украина, Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича
E-mail: vgeorge@chnu.cv.ua

Дата поступления в редакцию
10.11.2005 г.
Оппонент В. Г. ЮРЬЕВ
(ЦКБ "Ритм", г. Черновцы)

ОПТИМИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СПЕКТРОФОТОМЕТРА СФ-20

Относительная погрешность электронного тракта измерения оптических параметров <0,025%; время полного цикла измерения оптического спектра пропускания в диапазоне 0,19...2,5 мкм не превышает 20 мин.

Спектрофотометр СФ-20 предназначен для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности химических растворов и кристаллических сред в диапазоне длин волн 0,185...2,5 мкм. В приборе используется двухлучевая оптическая схема измерений, которая состоит из опорного и измерительного оптических каналов и позволяет учитывать оптическое пропускание атмосферы в исследуемом волновом диапазоне. Незначительная модернизация механической части измерительного канала позволяет практически одновременно измерять как спектры пропускания, так и отражения. Эти особенности данного прибора обеспечивают уникальные возможности для его применения при комплексном исследовании параметров полупроводниковых соединений A^2B^6 , A^3B^5 и барьерных структур на их основе, используемых в качестве элементов волоконно-оптических систем связи с низкими потерями и большой шириной полосы пропускания в диапазоне 0,4...1,8 мкм [1].

Предложенное в [2] устройство сопряжения позволяет полностью автоматизировать процесс измерений при подключении СФ-20 к IBM PC. Однако практическая эксплуатация устройства сопряжения показывает, что отдельные функции, предусмотренные схемотехническим и программным решением, хотя и расширяют возможности управления прибором, но используются крайне редко. Так, практически не используются переключатели скорости развертки спектра и прокрутки бумаги встроенного самописца. Калибровку по стопроцентной линии пропускания, режимы «многократного» измерения спектра и быстрой «прокрутки» спектрального диапазона можно эффективнее реализовать, используя исключительно коммутацию кнопок запуска прямого, обратного хода и остановки развертки спектра при непрерывном измерении текущего значения длины волны. Аналогично на уровне управляющего программного обеспечения реализован режим поиска и установки начального значения длины волны измеряемого спектрального диапазона.

Поэтому целью данной работы была оптимизация аппаратно-программного обеспечения для упрощения схемотехнического решения устройства сопряжения и повышения точности измерений.

Для измерения аналоговых сигналов длины волны λ , коэффициентов оптического пропускания T и поглощения D в приборе использованы встроенные механические преобразователи угла поворота движка резистивного делителя в соответствующие значения сопротивления и напряжения. Номинальные значения сопротивлений резистивных делителей для трех диапазонов λ ($\lambda_1=186\ldots340$ нм, $\lambda_2=340\ldots800$ нм, $\lambda_3=800\ldots2500$ нм) составляют 10 к Ω и для оптических параметров — 4 к Ω . Для их питания целесообразно использовать источник постоянного напряжения $U_0=5$ В. Это позволяет согласовать величину измеряемого сигнала с динамическим диапазоном 12-разрядного аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) последовательного типа ADS7822P. Чувствительность входного каскада данного АЦП оказывается достаточной для прямого измерения сигналов λ и T в различных диапазонах без применения дополнительных усилительных каскадов.

Согласно численным оценкам, в первом волновом диапазоне изменение λ , составляет $\Delta\lambda_1=\lambda_{\max}-\lambda_{\min}=154$ нм. Разрешающая способность резистивного делителя $R_1=10$ к Ω в этом диапазоне составит $\delta_{R1}=R_1/\Delta\lambda_1=64,94$ Ом/нм, что соответствует чувствительности по напряжению $\delta_{U1}=U_0/\Delta\lambda_1=32,5$ мВ/нм. Учитывая, что диапазон измеряемых напряжений используемого АЦП также составляет 5 В, а точность преобразования ограничена половиной значения младшего разряда [3, 4], то погрешность АЦП при измерении напряжения находится в пределах $\Delta_{AЦП}=\pm 0,6$ мВ. Полученное значение теоретически обеспечивает абсолютную погрешность в измерении λ_1 не хуже $\Delta_1=0,037$ нм. В то же время погрешность используемого в приборе механического датчика λ составляет $\Delta_{M1}=\pm 0,1$ нм. Для второго (λ_2) и третьего (λ_3) диапазонов, а также для коэффициента пропускания T ($\Delta T=1\ldots100\%$) соответственно получим значения $\delta_{U2}=10,9$ мВ/нм, $\Delta_2=0,11$ нм; $\delta_{U3}=2,9$ мВ/нм, $\Delta_3=0,4$ нм; $\delta_{U_T}=0,05$ В/%, не уступающие соответствующим техническим характеристикам прибора ($\Delta_{M2}=\pm 0,2$ нм, $\Delta_{M3}=\pm 0,4$ нм). При этом относительная погрешность во всех случаях в середине измерительного диапазона составляет $\varepsilon=0,024\%$.

ВОПРОСЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Для повышения точности измерений λ можно использовать АЦП большей разрядности [3]. Однако в этом нет необходимости, поскольку гистерезис изменения сопротивления механического датчика вследствие износа может составлять $\Delta_R = 20 \dots 30$ Ом, что соответствует ошибке по Δ_M приблизительно 2 нм. В процентном отношении для третьего диапазона это составляет 0,12%.

Погрешность динамических измерений определяется рабочей тактовой частотой f_T АЦП. В данном случае она составляет $f_T = 75$ кГц. Частота выборки аналогового сигнала для 12-разрядного АЦП при этом теоретически может достигать более 6 кГц. При минимальной скорости развертки спектра $v_{\min} = 0,5$ нм/мин можно произвести $7,5 \cdot 10^5$ измерений λ на интервале $\Delta\lambda = 1$ нм. Погрешность метода в этом случае составляет $\Delta\lambda_{\min} = 1,33 \cdot 10^{-6}$ нм. Для максимальной скорости развертки $v_{\max} = 128$ нм/мин получим $\Delta\lambda_{\max} = 0,34 \cdot 10^{-3}$ нм.

Учитывая приведенные оценки, оптимизированная функциональная схема устройства сопряжения может состоять из наиболее упрощенных блоков измерения аналоговых сигналов и управления силовыми приводами прибора (рис. 1). Измерительный блок включает АЦП (ADC) и коммутатор входных сигналов (MUX) на интегральной схеме (ИС) ADG608 (аналог ИС

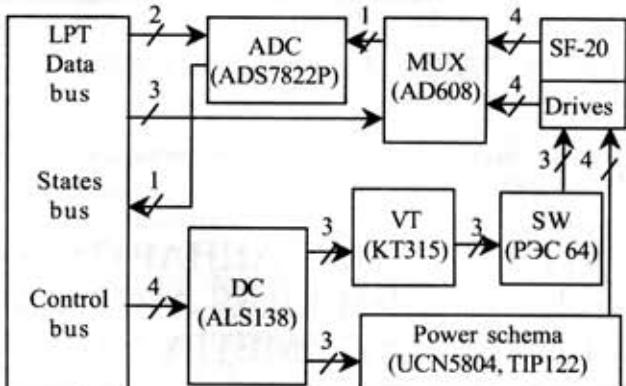


Рис. 1. Функциональная схема устройства сопряжения спектрофотометра СФ-20 с компьютером K561КП2). Управление измерительной частью осуществляется по шине данных (Data bus) LPT-порта. При этом младшие два бита используются для инициализации и подачи тактовых импульсов на АЦП, а следующие три бита — для дешифрации входов коммутатора. Цифровой сигнал с АЦП вводится в компьютер по одной сигнальной линии шины состояний (States bus) LPT-порта.

Силовая часть включает блок управления реле РЭС-64, предназначенных для коммутации ключей

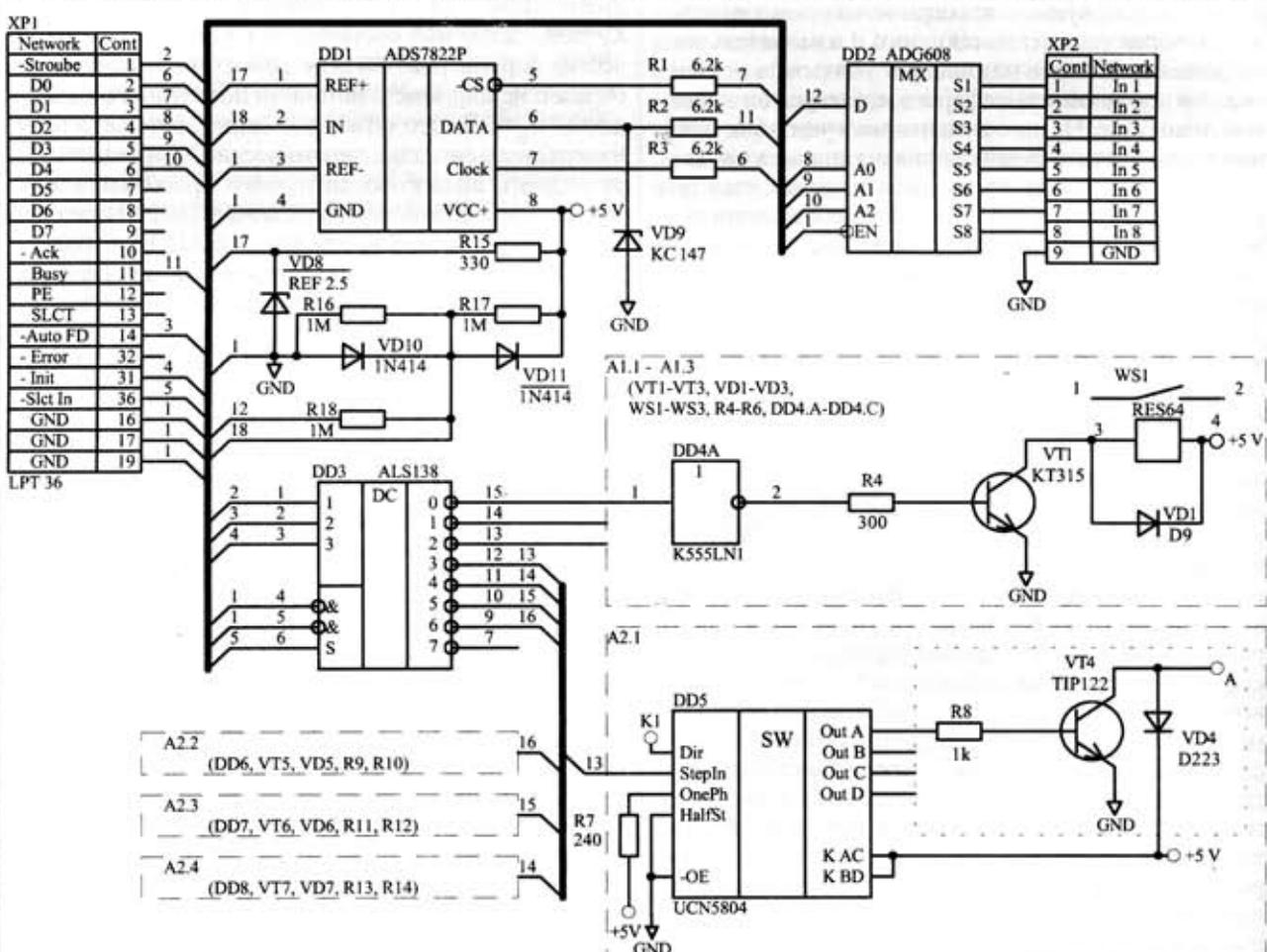


Рис. 2. Принципиальная электрическая схема устройства сопряжения:

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема устройства сопряжения:
 DD1—ADS7822P; DD2—ADG608; DD3—ALS138; DD4—ALS04; DD5-DD8—UCN5804; VT1-VT3—KT315Г; VT4-VT7—TIP122;
 VD1-VD3—D9; VD4-VD7—D223; WS1, WS2—PЭC64; WS3—PЭC55; VD8—REF2.5; VD9—KC147; VD10, VD11—IN414

ВОПРОСЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Условия измерения оптических параметров в разных волновых диапазонах спектрофотометра

Волновой диапазон λ , нм	Порядок дифракции	Дифракционная решетка	Источник излучения	Фотоприемник
190—340	II	Ф	Д	ФЭУ
340—800	I	Ф	Н	ФЭУ
800—2500	I	К	Н	ФС

прямого хода, остановки и обратного хода развертки спектра, а также блок управления двигателями (Power schema) для коммутации источника (дейтериевой — Д, или накальной — Н лампы (см. таблицу)) и приемника лучистой энергии (фотоэлектронного умножителя — ФЭУ или фотосопротивления — ФС), а также для изменения типа дифракционной решетки (Ф, К) и шкалы порядка дифракции (I, II).

Управление силовой частью реализовано по четырем сигнальным линиям шины управления (Control bus) LPT-порта [4] (рис. 2). Дешифрация ключевых транзисторных элементов осуществляется с помощью ИС ALS138 (аналог K1533ИД7). Схемотехническая реализация силового привода зависит от типа используемых электродвигателей (Drives) [5]. Режимы коммутации фаз шаговых двигателей можно формировать специализированными ИС UCN5804 или MC3479, а необходимая выходная мощность каскада обеспечивается силовыми ключами TIP122 или LU024N. Коммутация сигнала управления Dir ИС UCN5804 для изменения направления вращения двигателей (вход K1 на DD5, рис. 2) осуществляется с помощью концевых выключателей при двух крайних фиксированных положениях якоря двигателя. Поэтому кроме четырех аналоговых сигналов с СФ-20 на АЦП через мультиплексор дополнительно коммутируются четыре логических сигнала с концевых выключателей (рис. 1).

Общий алгоритм считывания и обработки данных с LPT-порта следующий:

1. Выбор начальных параметров эксперимента: начального и конечного значения λ исследуемого волнового диапазона и типа измеряемой оптической постоянной — пропускания T или оптической плотности D . Открытие файла *.dat для записи данных измерений.

2. Автоматическая установка исходного состояния измерительной системы по результатам анализа исходных параметров датчиков контроля λ согласно таблице.

3. Автоматический запуск измерений с записью данных в файл *.dat и выводом результатов в графическом интерфейсе пользователя в режиме реального времени.

4. Остановка процесса сканирования и закрытие файла данных при достижении граничного значения λ с переходом в диалоговый режим опроса управляемой программы на дальнейшую обработку полученных результатов или проведение нового цикла измерений.

Измеренные спектры пропускания, которые демонстрируют реальные возможности применения предложенного аппаратно-программного обеспечения для различных веществ, показаны на рис. 3. Хотя волн-

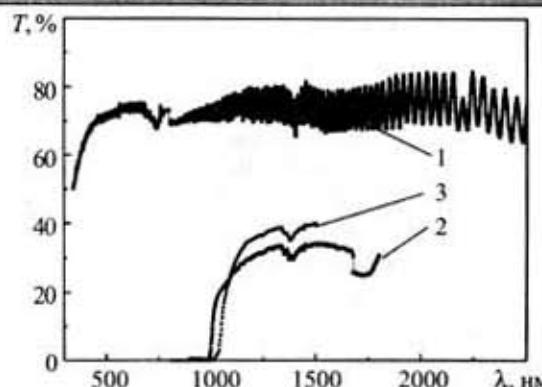


Рис. 3. Спектры пропускания:
1 — слюда; 2 — CdTe; 3 — n-Si

вая чувствительность прибора $\delta\lambda$, и уменьшается с возрастанием λ , однако является достаточной, чтобы выявить интерференционные особенности спектра пропускания слюды в длинноволновой области (рис. 3, график 1). Вычисленные по волновому краю поглощения значения ширины запрещенной зоны для CdTe ($E_g = 1,65$ эВ) и n-Si ($E_g = 1,12$ эВ) согласуются с литературными данными.

В общем случае резистивные делители, используемые в качестве преобразователей типа "сопротивление — напряжение — длина волны", характеризуются достаточно высокой линейностью зависимости $\lambda(U)$. Поэтому реальное значение длины волны $\lambda(U)$, измеряемой АЦП, хорошо аппроксимируется прямо пропорциональной зависимостью

$$\lambda(U) = \lambda_{\min} + (\lambda_{\max} - \lambda_{\min})(U_{\lambda} - U_{\min})/(U_{\max} - U_{\min}),$$

где длины волн λ_{\max} , λ_{\min} и соответствующие им напряжения U_{\max} , U_{\min} , снимаемые с преобразователей, определяются экспериментально по шкале механического счетчика откалиброванного прибора и показаниям цифрового вольтметра при максимальном и минимальном сопротивлении резистивного преобразователя для соответствующего волнового диапазона; U_{λ} — мгновенное значение напряжения на резистивном преобразователе, соответствующее текущему значению измеряемой длины волны.

Аналогичное соотношение используется и для расчета измеряемого значения оптических параметров.

При значительном отклонении от линейности зависимости $\lambda(U)$ можно использовать режим сопровождения спектра реперными метками [2]. Однако более оптимальным является введение в программу управления и обработки соответствующей калибровочной кривой.

Существенное влияние на точность измерений, а главное — на стабильность работы устройства сопряжения, проявляет "дребезг контактов" резистивных преобразователей. Статистический анализ результатов экспериментальных измерений показывает, что проникновение в измерительный канал АЦП сигналов на уровне 2—30 мВ приводит к ошибке определения λ на уровне 0,1—1,0 нм. Такие помехи можно эффективно отфильтровать — как схемотехнически, так и программно, используя статистическую обработку и цифровую фильтрацию результатов измерений. Грубые "промахи" измерений, обусловленные

ВОПРОСЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

сигналами "дребезга" до 80—100 мВ, проявляются в виде отклонений λ на несколько десятков нанометров и могут приводить даже к ложной автоматической перекоммутации текущего исследуемого волнового диапазона. Частота появления таких сигналов в процессе измерений, как правило, не превышает значений 1:50—1:100. Их фильтрация осуществляется программно с помощью логического оператора

If ((a)>=(as+N)) or ((a)<=(as-N)) then A else as:=a.

Здесь a , as — соответственно текущее и предыдущее значения измеряемой величины λ ; N — задаваемый параметр фильтрации (обычно $N=2\dots3$ нм); A — процедура аналогово-цифрового преобразования, измерения и приведения к нормированной шкале измеряемой величины.

Значительного повышения точности измерений и уменьшения погрешностей, обусловленных использованием механических преобразователей в кинематической схеме прибора, можно достичь, заменив резистивные делители оптронными датчиками с открытым оптическим каналом. Однако, как показано в [2, 3], для расчетных соотношений, графического отображения и интерпретации физических результатов исследуемых характеристик полупроводниковых материалов и структур вполне достаточно достигнуть такой точности измерений.

Программное обеспечение для управления прибором и обработки результатов измерений может быть выполнено на любом языке программирования вы-

сокого уровня и определяется возможностями используемого компьютера и операционной системы (ОС). Оптимальным вариантом является Borland Pascal с ОС Windows 9x, что допускает прямое обращение к портам ввода-вывода на программном уровне.

Таким образом, разработанный вариант оптимизированной принципиальной схемы устройства сопряжения и программного обеспечения с двойной фильтрацией сигналов на программном уровне обеспечивает относительную погрешность электронного измерительного тракта не более 0,025%. Время одного полного цикла измерений оптического спектра в диапазоне от 0,19 до 2,5 мкм и автоматической обработки результатов не превышает 20 минут.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Optical and infrared detectors / Ed. by R. J. Keyes. — Berlin—Heidelberg—New York: Springer-Verlag, 1980.
2. Воробец Г. І., Воробец О. І., Воропаєва С. Л., Горлей П. М. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар'єрних структур на основі напівпровідникових сполук A^2B^6 , A^3B^5 // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Фізика. — 2004. — Вип. 6. — С. 40—42.
3. Воробец Г. І., Воробец О. І., Горлей П. М. Шістнадцятирізрядний аналогово-цифровий перетворювач сигналів для шини ISA IBM PC // Наук. вісник Чернівецьк. ун-ту. Фізика. Електроніка. — 2002. — Вип. 133. — С. 109—112.
4. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. — С.-Петербург: Питер, 2001.
5. Ан П. Сопряжение ПК с внешними устройствами. — М.: ДМК Пресс, 2004.

НОВЫЕ КНИГИ

НОВЫЕ КНИГИ



Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры.— М.: Техносфера, 2005.— 336 с.

Первое учебное пособие в новой области на стыке аналитической химии, электроники, физики и медицины. Особенно подробно описаны электрохимические, оптические, гравиметрические, температурные сенсоры, распознавание ионов и молекул, «лаборатории-на-чипе». Пособие предназначено для студентов и специалистов в областях медицинских и биотехнологий, пищевой промышленности и контроля окружающей среды, микробиологов, специалистов, разрабатывающих и применяющих микроаналитические системы.

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

- Формирование нелинейного сигнала при воздействии на материальные объекты в целях передачи информации. (Россия, г. Воронеж)
- Зависимость сопротивления металлических квантовых проводов от температуры. (Россия, г. Москва)
- Современная инфракрасная термографическая технология, используемая при профилактическом обслуживании оборудования. (Сербия и Черногория, г. Бор)
- Высокостабильный СВЧ генераторный модуль для быстродействующих распределенных информационно-управляющих систем. (Украина, г. Днепропетровск)
- Технологические источники ионов на основе контрагированных разрядов. (Россия, г. Рубежное)
- Исследование влияния легирующих добавок на теплостойкость, теплопередачу никелевых покрытий корпусов ИС. (Украина, г. Ивано-Франковск)
- Компьютерная система анализа случайных потоков шумовых импульсов кремниевых диодов с микроплазмами. (Беларусь, г. Минск)
- О механизме насыщения тока стока полевого транзистора. (Узбекистан, г. Ташкент)
- Разброс параметров полевых транзисторов с барьером Шоттки на GaAs. (Украина, г. Днепропетровск)

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции